

扫描隧道显微镜在工业上的一些应用

吴超明

(东南大学物理系)

Virgil Elings

(美国数字仪器公司)

用扫描隧道显微镜^[1-3] (STM) 探测原子量级的表面结构,是大家熟知的。除了观察材料表面的原子和分子外,在工业上人们常用STM来研究样品的表面特征,扫描范围可以从0.01 μm 到 200.00 μm。这样的分辨率,扫描电镜(SEM)也能达到。不过,SEM测不出Z方向的微小距离,而STM却可保持在Z方向有较高的分辨率。因此,在工业上用STM观察在Z方向有微小高差特征的表面结构,例如光滑轴承表面的抛光情况,衍射光栅上锯齿形刻槽的深度,圆珠笔中圆珠表面的粗糙程度等,是十分有效的。这里,我们将介绍用STM测量袖珍唱片(CD)和集成电路(IC)所得到的结果。

CD片上有许多模压条,隆出表面,以便将数据印在唱片上。这些隆起的模压条大约有130 nm 高,600 nm 宽,长度不等。片上则按设计者的需要,具有各种不同的电路图案,按不

同层次排列,高低变化也很陡峭。为了测出它们的图象,STM中控制Z向高度的反馈线路必须反应很快,使探针沿陡壁直上直下而不触及样品表面。我们使用的是美国数字仪器公司生产的STM——Nano Scope II,它包括三个部分:显微镜、控制器和计算机,见图1。在计算机控制下,一个步进马达微微旋起显微镜基部上的细调螺丝,使探针逐渐逼近样品表面,一旦产生隧道电流,马达自动停止。此时探针便开始扫描,各种需要的参数可通过键盘打入计算机的菜单(meau),使扫描运动处于最佳状态,并从屏幕上得到相应的STM图象。除了在电子线路、机械传动和计算机软件控制上已保证探针有足够的反应能力外,在实际测量中,还应做到几点:(1)使用较慢的扫描频率,在X方向单次扫描频率一般控制在0.2—0.5 Hz。(2)选择400×400象点的成象方式,增加图象层次表现力。(3)样品要放平,使探针在X和Y

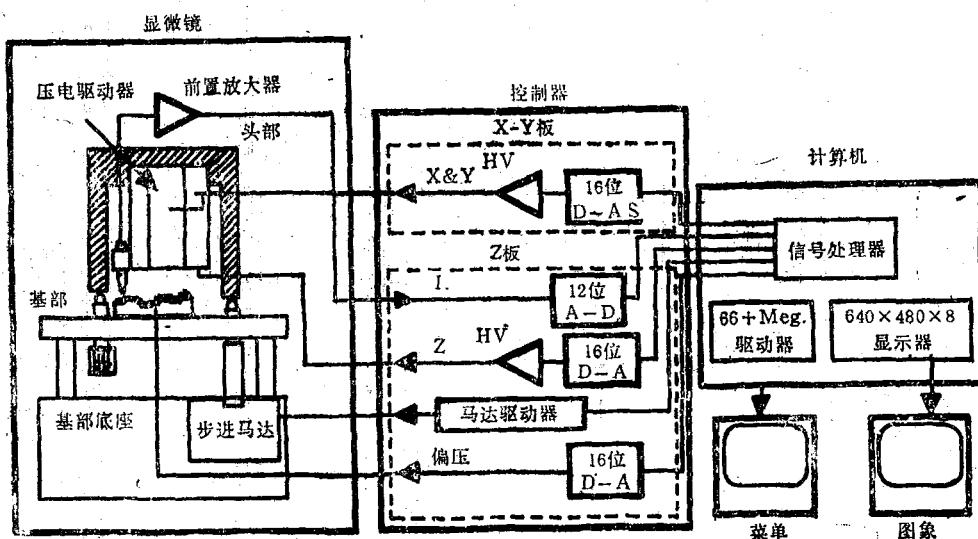


图1 Nano Scope II 原理方框图

方向上扫描时，没有大的倾斜坡度。（4）使用特制的探针。我们是用化学腐蚀的方法来制作这种探针。方法如下：用钨丝作为探针原材料，将其一端置入 5% 的亚硝酸钠溶液中 2 mm，另一端接入电源，如图 2(a) 所示。用铂-铱合金丝作为电极，浸入溶液后，通上 30 V 的交流电压，便可看到钨丝在溶液中发生了腐蚀作用，先是大量气泡出现，继而出现火花。当火花由钨丝末端逐渐升至液面即将熄灭时，迅速切断电源，并将探针浸入防氧化剂中。此种探针的尖端形状如图 2(b) 所示，细而尖长，在扫描中可以紧密地靠近 CD 和 IC 样品上的竖直边缘，从而产生比较真实的 STM 图象。

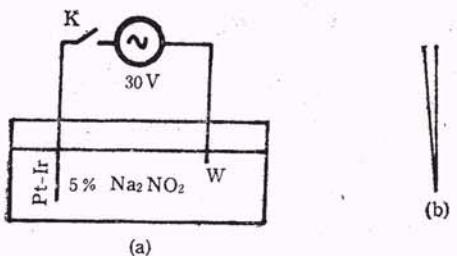


图 2 (a) 制作探针示意图；(b) 探针的截面图

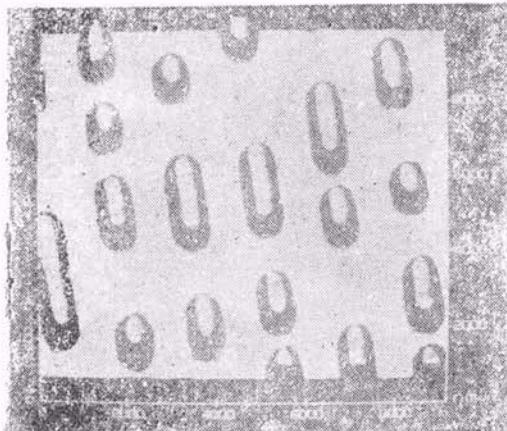


图 3 CD 噗片上的模压条块

测量结果可见图 3—5。

图 3 是 $9 \times 9 \mu\text{m}$ CD 表面图。样品与探针间的偏压为 200 mV，隧道电流设置点（在仪器上称为 setpoint current，它不是真正的隧道电流，而是反馈线路中的一个重要参数）。

为 0.24 nA。

图 4 是用超大扫描范围 ($220 \times 220 \mu\text{m}$) 获得的 IC 表面结构的表面图，偏压为 80 mV，电流设置点为 2.7 nA。

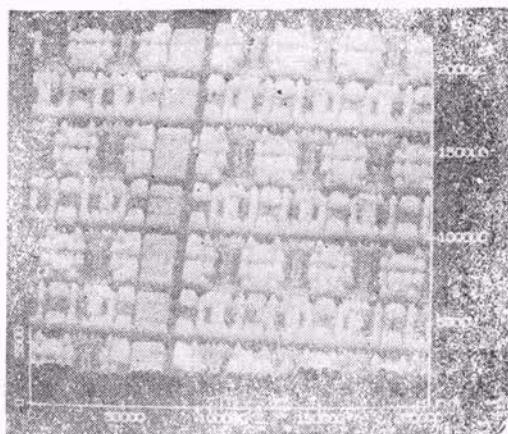


图 4 大范围扫描得到的 IC 表面结构

图 5 是一个反映某 IC 片上局部区的三维立体线扫描图，偏压为 80 mV，电流设置点为 4.4 nA。从图 5 中可以清楚地看到高低不同层次在 Z 方向上的差别。

由以上可见，STM 获取的信息十分有助于制造厂商监视并控制生产，制造出高质量的 CD 和 IC 产品。

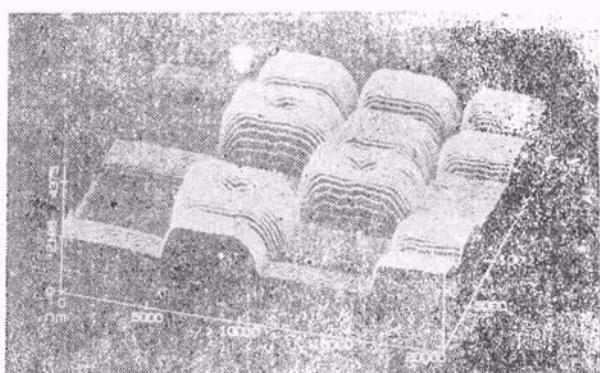


图 5 IC 的三维立体线条图

- [1] G. Binning et al., *Phys. Rev. Lett.*, 49(1982), 57.
- [2] G. Binning and H. Rohrer, *Surf. Sci.*, 126(1983), 236.
- [3] G. Binning et al., *Phys. Rev. Lett.*, 50(1983), 120.